**Nazwa przedmiotu:**

Mikrourządzenia MEMS

**Koordynator przedmiotu:**

prof. dr hab. inż. Zygmunt Rymuza

**Status przedmiotu:**

Obowiązkowy

**Poziom kształcenia:**

Studia I stopnia

**Program:**

Mechatronika

**Grupa przedmiotów:**

Obowiązkowe

**Kod przedmiotu:**

MUM

**Semestr nominalny:**

7 / rok ak. 2012/2013

**Liczba punktów ECTS:**

2

**Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:**

Obliczanie punków ECTS: wykład 30, studia literaturowe i przygotowanie do zaliczania wykładu 25
Razem 55 godzin =2 ECTS

**Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:**

Obliczanie punktów ECTS: wykład 30
Razem 30 godzin = 1 ECTS

**Język prowadzenia zajęć:**

polski

**Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:**

**Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:**

|  |  |
| --- | --- |
| Wykład: | 30h |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

**Wymagania wstępne:**

Podstawy fizyki i budowy materiałów, podstawowe wiadomości z mikromechatroniki

**Limit liczby studentów:**

30

**Cel przedmiotu:**

Uzyskanie wiadomości dotyczących budowy i zastosowań mikrourządzeń wykonywanych w technologii mikrosystemów (MEMS)

**Treści kształcenia:**

Podstawowe informacje dotyczące techniki MEMS
Systematyka mikrosystemów , stosowane techniki wytwarzania, materiały, problemy niezawodnościowe i trwałościowe.
Projektowanie i konstruowanie mikrourzadzeń MEMS.
Problematyka badań mikrosystemów.
Przykłady zastosowania mikrosystemów:
Czujniki ciśnienia, akcelerometry, czujniki siły i momentu, przepływomierze
Czujniki magnetyczne, chemiczne i biochemiczne
Przełączniki , filtry, anteny
Mikrosilniki liniowe i obrotowe, siłowniki, wibrosilniki, złożone mikromechanizmy napędowe, chwytaki, urządzenia pozycjonujące
Podstawy budowy, pompy, zawory, miksery, reaktory, zastosowania
Mikromaszyny, mikroroboty , urządzenia DLP, skanery, spektrometry
Zastosowania w życiu codziennym, w nanotechnice, militarne i kosmiczne, w technice medycznej, w przemyśle, motoryzacji itp., trendy rozwojowe. Dynamika rozwoju rynków urządzeń MEMS/NEMS.

**Metody oceny:**

Zaliczanie pisemne wykładu

**Egzamin:**

nie

**Literatura:**

Dziuban J.A., Technologia i zastosowanie mikromechanicznych struktur krzemowych i krzemowo-szklanych w technice mikrosystemów. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2004
Maluf W., Williams K., An Introduction to Microelectromechanical Systems Engineering, Artech House, Boston, 2004
S.Senturia, Microsystem Design, Kluwer, Boston 2001
Gardner J.W., Microsensors MEMS and Smart Devices, J.Wiley, Chichester 2001
Beeby S., Ensell, Kraft M., White N., MEMS Mechanical Sensors, Artech House, Boston 2004
Pustan M., Rymuza Z., Mechanical and Tribological Characterization of MEMS Structures, Risoprint, Cluj-Napoca 2007

**Witryna www przedmiotu:**

mchtr.pw.edu.pl

**Uwagi:**

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

**Efekt MUMS\_W01:**

Zna podstawy budowy mikrorzadzeń MEMS i ich wyboru jako produktów rynkowych do zastosowania jako podzespoły budowanych urządzeń mechatronicznych lub jako gotowych mikrourządzeń.

Weryfikacja:

kolokwium

**Powiązane efekty kierunkowe:** K\_W03, K\_W17

**Powiązane efekty obszarowe:** T1A\_W02, T1A\_W05

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

**Efekt MUMS\_U01:**

jest przygotowany do zawodowego rozwoju w tej specjalności i potrafi wybrać mikrourządzeń jako podzespoły do budowy urządzeń mechatronicznych.

Weryfikacja:

kolokwium

**Powiązane efekty kierunkowe:** K\_U08, K\_U21

**Powiązane efekty obszarowe:** T1A\_U16, T1A\_U12, T1A\_U15

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

**Efekt MUMS\_K01:**

Jest przygotowany do propagowania wiedzy o nowoczesnej technice mikrorządzeń MEMS

Weryfikacja:

kolokwium

**Powiązane efekty kierunkowe:** K\_K01, K\_K03

**Powiązane efekty obszarowe:** T1A\_K01, T1A\_K02, T1A\_K07